

第 39 回分析電子顕微鏡討論会のお知らせ

主催：公益社団法人 日本顕微鏡学会 分析電子顕微鏡分科会

協賛：軽金属学会、日本金属学会、日本材料学会、触媒学会、日本熱処理技術協会、日本表面真空学会、日本鉄鋼協会、日本分析化学会、応用物理学会、日本セラミックス協会、日本物理学会（依頼中含む）

日 程：2024 年 12 月 5 日（木）、6 日（金）

方 法：オンラインでの開催

定 員：150 名

参加費（予稿集合む）：顕微鏡学会員及び協賛学会員（個人会員）3,000 円、非会員 4,000 円、学生 1,000 円

※ 日本顕微鏡学会会員の参加費は不課税、その他は税込となります。

内 容：分析電子顕微鏡に関わるチュートリアルと研究トピックスについて講演が行われます。「チュートリアル」では、分析電顕の基軸となる EDS、EELS、STEM の基礎について詳しい講演がなされます。初日のトピックセッションでは、「EELS の最新動向」に焦点をあてて研究事例を紹介します。二日目は「電子顕微鏡とカソードルミネッセンス（CL）」に関する講演、ならびに「試料作製」に関するチュートリアル講演がなされます。分析電顕に関わる活発な討論の機会となりますよう奮ってご参加ください。

詳細は <https://sites.google.com/view/bunseki-touron-39/> をご覧下さい。

申込方法：参加申し込みは氏名、勤務先、所属、住所、電話番号、Fax 番号、e-mail アドレス、申込資格（会員・協賛学会員・学生・非会員）をご記入の上、e-mail にて下記連絡先へお申し込み下さい。

参加費のお支払方法などについては折り返しご連絡差し上げます。

申込締切：2024 年 11 月 26 日（火）

連絡先：〒060-8628 札幌市北区北 13 条西 8 丁目

北海道大学大学院工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター
マルチスケール機能集積研究室

分析電子顕微鏡討論会事務局 坂口 紀史

Tel&Fax: 011-706-6768 E-mail: bunseki.touron.39@gmail.com

第 39 回分析電子顕微鏡討論会プログラム（案）

（2024 年 8 月 23 日現在）

12 月 5 日(木) 9:30-16:00

1. チュートリアル

9:30-	EDS の基礎	福永啓一（日本電子）
10:10-	EELS の基礎と応用	佐藤庸平（東北大学）
10:50-	走査透過型電子顕微鏡法（STEM）について	佐藤幸生（熊本大学）
11:30-	休憩（10 分）	
11:40-	Q&A（20 分）	

— 昼休み（12:00-13:30） —

2. トピック 1 「EELS の最新動向」

13:30-	高エネルギー電子線損失分光システムの開発と期待される応用研究	渡辺万三志（東北大, Lehigh 大）
14:00-	単色電子源を用いた低次元材料分析	千賀亮典（産総研）
14:30-	ペロブスカイト型 Ti 酸化物における Ti L2,3-edge ELNES からの酸素熱振動因子の抽出	治田充貴（京都大学）
15:00-	EELS スペクトルのソフトウェア解析における最近の動向	溝口照康（東京大学）
15:30-	休憩（10 分）	
15:40-	Q&A（20 分）	

12 月 6 日(金) 10:00-16:10

1. 試料作製

10:00-	試料作製法概論	原徹（物質・材料研究機構）
10:30-	FIB を用いた電子顕微鏡用試料作製	仲野靖孝（日立ハイテク）
11:00-	ウルトラマイクローム技法の基礎と最近のアプリケーション	長澤忠広（ライカマイクロシステムズ）
11:30-	休憩（10 分）	
11:40-	Q&A（20 分）	

— 昼休み（12:00-13:30） —

2. トピック 2 「電子顕微鏡とカソードルミネッセンス（CL）」

13:30-	カソードルミネッセンス/EBIC を使った半導体材料の機能評価と欠陥研究 — 基礎と応用	関口隆史（筑波大学）
		陳君（物質・材料研究機構）
14:10-	透過電子顕微鏡カソードルミネッセンス開発の歴史	山本直紀（東工大）
14:40-	多次元カソードルミネッセンス	三宮工（東工大）
15:10-	カソードルミネッセンスによる光-物質相互作用の研究	斉藤光（九州大学）
15:40-	休憩（10 分）	
15:50-	Q&A（20 分）	